



Sverige

(12) Patentskrift

(10) SE 527 204 C2

(21) Patentansökningsnummer 0401372-8
(45) Patent meddelat: 2006-01-17
(41) Ansökan allmänt tillgänglig: 2006-01-17
(22) Patentansökan inkom: 2004-05-28
(24) Löpdag: 2004-05-28
(83) Deposition av mikroorganism: ---
(30) Prioritetsuppgifter: ---

(62) Internationell klass:
G01B 13/06 (2006.01)
G01B 7/06 (2006.01)

(73) Patenthavare: Daprox AB, Skärholmen SE

(72) Uppfinnare: Bengt Åkerblom, Vårby SE

(74) Ombud: Albihs Stockholm AB

(54) Benämning: Mätanordning och förfarande

(56) Anförda publikationer: US A 5 616 853

(47) Sammandrag: Föreliggande uppfinning hänför sig till en mätanordning (1) och ett förfarande för tjockleksmätning av åtminstone ett skikt (2) hos en rörlig bana. Mätanordningen (1) innefattar en i ett givarhus (3) axiellt rörlig givarkropp (4) med ett från givarhuset (3) utskjutande sensorhuvud (5), anordnat att via en gaskudde vila mot skiktet (2) och ett övre parti (6), som sträcker sig in i en i givarhuset (3) avgränsad kammare (7). Givarhuset (3) är försett med åtminstone en anslutning (9) för tillförsel av gas, vilken delvis bildar nämnda gaskudde och delvis strömmar in i kammaren (7). Givarhuset (3) är försett med en strypning (10) för utförsel av gas från kammaren (7) och åtminstone en trycksensor (38) är anordnad för bestämmande av gstrycket i kammaren (7). Tjockleken på skiktet (2) mäts medelst mätanordningen (1), varvid strypningen (10) föregående mätningen ställs in på så sätt, att gaskudden utövar ett tryck mot skiktet (2) motsvarande en vikt på 0-65 g/cm².

